



19 **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

12 **Patentschrift**
10 **DE 44 42 045 C 2**

51 Int. Cl.⁶:
G 02 B 5/28
G 02 B 1/00

21 Aktenzeichen: P 44 42 045.5-51
22 Anmeldetag: 25. 11. 94
43 Offenlegungstag: 30. 5. 96
45 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 23. 4. 98

DE 44 42 045 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 **Patentinhaber:**
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

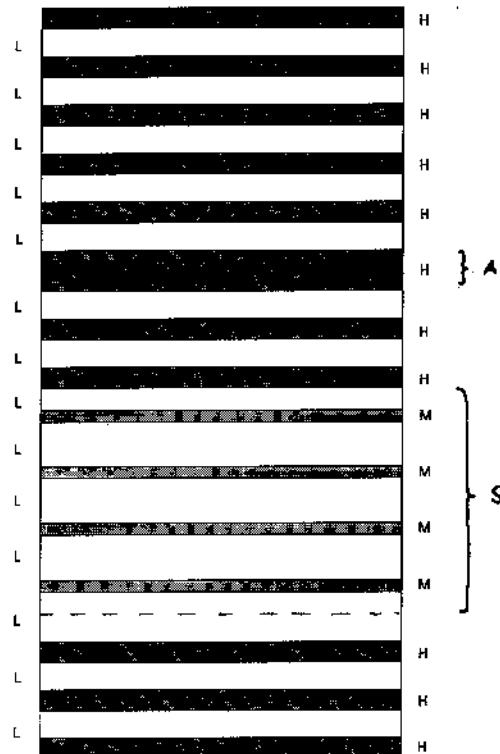
74 **Vertreter:**
PFENNING MEINIG & PARTNER, 80336 München

72 **Erfinder:**
Schallenberg, Uwe, 07749 Jena, DE; Uhlig, Hein,
07747 Jena, DE

56 **Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:**
DE 24 49 312 A1
GB 12 70 042
US 53 37 191
US 40 45 125
JP 62-1 78 906
H.A. Macleod: Thin-film opticals filters,
Bristol 1986, S. 504-508;

64 **Interferenzfilter**

57 Interferenzfilter, bei dem in einer Cavity-Anordnung auf
beiden Seiten einer Abstandsschicht (HA) Schichtenfol-
gen aus dielektrischen $\lambda/4$ -Schichten (H, L) mit alternie-
rend hohem und niedrigem Brechungsindex angeordnet
sind und bei dem auf einer der beiden Seiten der Ab-
standsschicht (HA) in die Schichtenfolge dielektrischer
Schichten asymmetrisch zur Abstandsschicht (HA) ein
Stützsystem (S) aus mehreren in alternierender Folge je-
weils aufeinander angeordneten dielektrischen und met-
allischen Schichten (M, L) eingefügt ist.



DE 44 42 045 C 2